【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成20年9月11日(2008.9.11)

【公開番号】特開2004-61516(P2004-61516A)
【公開日】平成16年2月26日(2004.2.26)
【年通号数】公開・登録公報2004-008
【出願番号】特願2003-280542(P2003-280542)
【国際特許分類】
　Ｇ０１Ｔ　1/20　(2006.01)
　Ａ６１Ｂ　6/03　(2006.01)
　Ｈ０４Ｎ　5/32　(2006.01)
【ＦＩ】
　Ｇ０１Ｔ　1/20　Ｇ
　Ｇ０１Ｔ　1/20　Ｂ
　Ａ６１Ｂ　6/03　３２０Ｓ
　Ｈ０４Ｎ　5/32

【手続補正書】
【提出日】平成20年7月30日(2008.7.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線検知器要素（１８）組立体であって、
　シンチレータ（４６）（５６）（６６）と光センサ（４４）とを備え、
　前記シンチレータが、前記光センサ（４４）に対して近位にある第１表面と、前記第１表面に対して遠位にあり放射線ビーム（１４）を受ける第２表面とを含み、
　前記シンチレータ（４６）（５６）（６６）の側部（６８）が、その上への放射線ビーム（１４）の衝突を遮って、該側部（６８）への前記衝突に対する前記光センサ（４４）の応答を減らすように構成され、
　前記シンチレータ（４６）（５６）（６６）が、階段状のカットを用いて前記第２表面から前記第１表面まで外向きに先細にされて、選択された焦点スポットの運動の範囲に対しては、前記放射線ビーム（１４）が、前記光センサ（４４）の付近において、別の側部（６８）上に衝突しないようになっており、
　前記第１表面における前記シンチレータ（４６）（５６）（６６）の大きさが、焦点スポットの運動の範囲により定められることを特徴とする放射線検知器。
【請求項２】
　前記第２表面が、前記放射線ビーム（１４）の一部が衝突し、前記衝突に対する前記光センサ（４４）の応答を減らすように、前記第１表面より大きく構成された該第２表面上にのみ存在することを特徴とする、請求項１に記載の放射線検知器（１８）。
【請求項３】
　前記放射線ビーム（１４）がＸ線ビームであることを特徴とする、請求項１に記載の放射線検知器要素（１８）。
【請求項４】
　入射放射線ビーム（１４）を検知する方法であって、
　光センサ（４４）に対して近位にある第１表面と、前記第１表面に対して遠位にある第

２表面とを含むシンチレータ（４６）（５６）（６６）の前記第２表面上に入射する放射線ビーム（１４）を受け、
　前記シンチレータ（４６）（５６）（６６）の側部（６８）上への衝突に対する前記光センサ（４４）の応答を減らすように構成された該側部（６８）により放射線ビーム（１４）の衝突を遮る、
段階を含み、
　前記シンチレータ（４６）（５６）（６６）が、階段状のカットを用いて前記第２表面から前記第１表面まで外向きに先細にされて、選択された焦点スポットの運動の範囲に対しては、前記放射線ビーム（１４）が、前記光センサ（４４）の付近において、別の側部（６８）上に衝突しないようになっており、
　前記第１表面における前記シンチレータ（４６）（５６）（６６）の大きさが、焦点スポットの運動の範囲により定められることを特徴とする方法。
【請求項５】
　前記第２表面を前記第１表面より大きく構成し、前記放射線ビーム（１４）の一部が前記第２表面上だけに衝突し、前記衝突に対する前記光センサ（４４）の応答を減らすようにすることを特徴とする、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記放射線ビーム（１４）がＸ線ビームであることを特徴とする、請求項４または５に記載の方法。
【請求項７】
　画像形成システムにおいて用いられる放射線検知器アレイ（６）であって、
　複数の光センサ（４４）を含む光センサ（４４）アレイと作動可能な構成で配設された、複数のシンチレータ（４６）（５６）（６６）を含むシンチレータ（４６）（５６）（６６）アレイを備え、
　前記複数のシンチレータ（４６）（５６）（６６）の各々のシンチレータ（４６）（５６）（６６）が、前記複数の光センサ（４４）の光センサ（４４）に対して近位にある第１表面と、前記第１表面に対して遠位にあり放射線ビーム（１４）を受ける第２表面とを含み、
　前記各々のシンチレータ（４６）（５６）（６６）の側部（６８）が、その上に衝突する放射線ビームを遮って、該側部への前記衝突に対する各々の光センサ（４４）のそれぞれの応答を減らすように構成され、
前記シンチレータ（４６）（５６）（６６）が、階段状のカットを用いて前記第２表面から前記第１表面まで外向きに先細にされて、選択された焦点スポットの運動の範囲に対しては、前記放射線ビーム（１４）が、前記光センサ（４４）の付近において、別の側部（６８）上に衝突しないようになっており、
　前記第１表面における前記シンチレータ（４６）（５６）（６６）の大きさが、焦点スポットの運動の範囲により定められることを特徴とする放射線検知器アレイ（６）。
【請求項８】
　入射放射線ビーム（１４）を検知するための手段であって、
　光センサ（４４）に対して近位にある第１表面と、前記第１表面に対して遠位にある第２表面とを含むシンチレータ（４６）（５６）（６６）の前記第２表面上に入射する放射線ビーム（１４）を受けるための手段と、
　前記シンチレータ（４６）（５６）（６６）の側部（６８）上への衝突に対する前記光センサ（４４）の応答を減らすように構成された該側部（６８）により放射線ビーム（１４）の衝突を遮るための手段と、
を含み、
前記シンチレータ（４６）（５６）（６６）が、階段状のカットを用いて前記第２表面から前記第１表面まで外向きに先細にされて、選択された焦点スポットの運動の範囲に対しては、前記放射線ビーム（１４）が、前記光センサ（４４）の付近において、別の側部（６８）上に衝突しないようになっており、

前記第１表面における前記シンチレータ（４６）（５６）（６６）の大きさが、焦点スポットの運動の範囲により定められることを特徴とする入射放射線ビーム（１４）を検知するための手段。

【請求項９】

前記第２表面を前記第１表面より大きく構成し、前記放射線ビーム（１４）の一部が前記第２表面上だけに衝突し、前記衝突に対する前記光センサ（４４）の応答を減らすようにすることを特徴とする、請求項８に記載の入射放射線ビーム（１４）を検知するための手段。

【請求項１０】

前記放射線ビーム（１４）がＸ線ビームであることを特徴とする、請求項８または９に記載の入射放射線ビーム（１４）を検知するための手段。